【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成26年5月15日(2014.5.15)

【公開番号】特開2012-223996(P2012-223996A)
【公開日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-048
【出願番号】特願2011-94255(P2011-94255)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｃ　1/14　(2006.01)
Ｂ４１Ｎ　1/24　(2006.01)
Ｂ４１Ｆ　15/36　(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/12　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｃ　1/14　１０１
Ｂ４１Ｎ　1/24
Ｂ４１Ｆ　15/36　Ｚ
Ｈ０５Ｋ　3/12　６１０Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月24日(2014.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
印刷パターンに対応した金属膜パターンをメッシュに接合して構成された印刷用マスクの製造方法において、
前記金属膜パターンと前記メッシュとの接合を、（１）台板の一面に形成された前記金属膜パターン上に前記メッシュを載置するステップと、（２）前記メッシュに透液性弾性体から成る押圧部材を圧縮しながら押し付けて該メッシュを前記金属膜パターンに密着させるステップと、（３）前記金属膜パターンと前記メッシュとをメッキ膜を介して接合するステップと、（４）前記押圧部材を前記メッシュから引き離すと共に、前記台板を前記メッシュから引き離して該台板から前記金属膜パターンを剥離するステップと、を経て行う、
ことを特徴とする印刷用マスクの製造方法。
【請求項２】
前記台板として、該台板の一面の前記金属膜パターンが存しない部分に該金属膜パターンと同じ厚さを有するレジスト膜パターンが形成されているものを用いる、
ことを特徴とする請求項１に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項３】
前記押圧部材を支持板の一面に設けて、該支持板を用いて前記押圧部材の押し付けを行う、

ことを特徴とする請求項１または２に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項４】
前記台板を導電体から形成して、該台板を前記メッキ膜を形成するときの陰極として用いる、
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項５】
前記支持板を導電体から形成して、該支持板を前記メッキ膜を形成するときの陽極として用いる、
ことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項６】
前記台板を絶縁体から形成し、且つ、該台板の前記一面側に電極層を設けて、該電極層を前記メッキ膜を形成するときの陰極として用いる、
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項７】
前記支持板を絶縁体から形成し、且つ、該支持板の前記一面側に電極層を設けて、該電極層を前記メッキ膜を形成するときの陽極として用いる、
ことを特徴とする請求項１～３及び６の何れか１項に記載の印刷用マスクの製造方法。
【請求項８】
前記透液性弾性体から成る押圧部材は、
発泡ウレタン、濾紙、不織布より選択される少なくとも一つであることを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の印刷用マスクの製造方法。